**2018년 진공기술 현장(삼성SDI) 교육 프로그램**

**□ 일 시/장소 : 2018.12.7(금) 09:00~17:00/장 소 : 삼성SDI 구미 사업장 내 교육장**

**□ 연락처 : 전화 : 강지윤 과장 010-4504-3777/이메일 :** [**jyjy.kang@samsung.com**](mailto:jyjy.kang@samsung.com)

강의 일자 및 과목

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **일 자** | **시 간** | **강의 제목** | **강 사** | |
| **소 속** | **성 명** |
| **2018년**  **12월**  **7일(금)** | **09:00~10:30** | **진공기술 관련 강좌** | | |
| **□진공용기의 설계**  **ㅇ 진공용기설계기초**  **ㅇ 소재의 선택**  **ㅇ Flange의 선택**  **ㅇ 진공용기의 안전두께 계산** | **선문대** | **김기원 교수** |
| **10:40~12:10** | **□진공기술의 기초 및 진공디자인**  **ㅇ 진공의 기초**  **ㅇ 진공배기의 특성**  **ㅇ 진공폄프의 용량 선정**  **ㅇ 진공디자인 및 운영환경** | **현민GVT** | **이동주박사** |
| **12:10~13:10** | **중 식** | | |
| **13:10~14:20** | **□진공박막증착법의 원리와 응용**  **ㅇ Precursor, 흡착 및 반응기초**  **ㅇ CVD 정의와 원리**  **ㅇ 박막 응용 예시** | **한양대** | **박진성 교수** |
| **14:30~15:40** | **□플라즈마 기초**  **ㅇ 플라즈마 소스**  **ㅇ RF 기술**  **ㅇ Plasman Simulation** | **동아대** | **김호준 교수** |
| **15:50~17:00** | **□PVD공정과 플라즈마 식각공정**  **ㅇ Physical Vapor Deposition**  **·Evaporation & Sputter Deposition**  **ㅇPlasma Etching and Etcher** | **성균관대** | **채희엽교수** |
|  | **교육 진행** | **KOVRA** | **고중희／이복연** |